## (9) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭58—116165

(1) Int. Cl.<sup>3</sup>(2) B 41 J 3/04

職別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60インク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

**@発明者 杉谷博志** 

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

出願人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

四代理 人,弁理士 丸島儀一

明 韻 書

1. 発明の名称

インク吸射ヘッド

### 2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を備えたインク递路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク噴射へっ ド。

# 3. 発明の詳細な説明

本発明はインタ噴射へッド、とりわけ、配像 用のインタ傷を形成するのに適用されるインタ 噴射ヘッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配録液を各種の方式 (例えば、舒電吸引力を利用する方式や圧電素 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細を吐出孔から噴出させて小 類化し、この小摘を紙等の被配録面に付着させ て記録を行なり所謂・インクジェット配録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 密度を高めるとと(つまり、ドットが逃続して いる方が印字品位は良好である。)が重要な課 滅である。

しかしながら、従来に於ては、製造技能上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るイ ンク噴射へッドを得るととは極めて困難をとと であった。

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを、目的とする。 換言すれば、本発明の主たる目的は、高街度インクドットを安定して形成し得ると共に、複型でコンパクトに構成されるインク噴射へッドを提供することにある。

斯かる目的を達成する本発明のインタ戦射へ ッドは、インク吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインタ吐 出孔を配数して放ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に 説明する。

特開昭58-116165(2)

第 1 図 (a) , (b) , (c) によって本発明の一実施側を示す。

第1図(a)は、一実施例としてのインク噴射へ、ドの外製針視図であり、第1図(b)、(c)は共に、第1図(a)のX、Y線に於ける切断面図である。

図に於て、1はガラス、セラミックス、アラス、アラス、大の東には金属等から成る基板であり、との基をして、1の片面には、発熱素子或は圧電素子等のののでは、発熱素子或は圧電素子等ののでは、200

度、生人に近接して配設することも可能である。

义、これに加えて、インク吐出孔様に案子2を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(g)と阿様に、一つのインク塩4 内に、インク吐出孔と同じ鉛数の互が分解した 業子2を配数することも可能である。

膜とAl, Au等の導電膜を交互に機能していく地 程に於いて導電膜をフォトリングラフイによっ て所望の配銀パターンにして構成する多層配額 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の業材から成るス ペーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くととによって素子2の上方にインク盒 4 水形成され、とのインク室 4 内には蓋板1の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク導 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、前記導管5をスペーサー3の一部に接続さ せることもできる。又、導管5の散量偶数も図 示例(1個)のみに限定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔78,7bを 設けた平板であり、これも美記芸板1と同様の 素材から成るものである。 そして前記したイン ク吐出孔7a,7bは微線加工技術の許す繰り 近接させて配設することができ、その偶数も国 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕嵐4に対して)3以上、何えば3個~5個個

次に、第 2 図 (a) , (b) , (c) によって、別の実施 例を説明する。

第2図(a) は、別の実施例としてのインク質射へ、ドの外級針視図であり、第2図(b) の(c) は共に、第2図(a) の(c) が 課に対ける切断面図である。 図に於て、11は第1回の基板1に、12は第1回のインク吐出圧発生素子2に、13は第1回のスペーサー3に、14a,14b,14c,14dは何れも第1回のインク宮4に、15は第1回の導管5に、16は第1図の平板6に、又、17a,17b,17e,17d,17e,17f,17g,17b,17bは何れも第1図のインク吐出孔に失々相当する構成要素であり、各々の詳細は第1図に立いて説明されているとかりである。

尚、この第2図々示例に於ても、第1図々示例と同様に、各インク吐出孔 17m , … , 17k は、後級加工技術の許す限り近接させて図示の如く 直線状若しくは不図示のジグザグ状に配飲する ととができ、その悩数も図示例に限定されるも のではまく、(一つのインタ館に対して) 3 以

特開昭58-116165 (3)

上、例えば3個~5個程度、互に近接して配設 することも可能である。

义、これに加えて、第1図×示例と阿様にインク吐出孔毎に分離されたま子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2図(c)と同様に、一つのインク型(例えば14×内に、インク吐出孔と同じ個数の互人に分離した素子12を配数するととも可能である。

3. しかも、インク吐出孔の高密度、微細加工 は比較的智易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り良く行えことができ る。毎の効果が得られる。

### 4. 図面の記事な説明

注1図(a),第1図(b),及び與1図(c)は、何れ ◆本発明に係る一実施的の説明Aであり、解1図 (a)は、一実施的としてのインク咳射へッドの外 観射視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX、X線に於ける切断面図である。

第2図(a) , 第2図(b) 及び 32図(c) は、何れも 本発明に係る他の実施例の説明図であり、第2 図(a) は長尺型インク噴射へ、どの外観射視図、

部2図(B)及び解2図(C)は共代、第2図(A)のY。 Y観に於ける切断面図である。

凶に於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14m,14b,14c,14d,はインク室、7m,7b,17m,17b,17c,17d,17m,17f,17g,17hはインク吐出孔である。

連続級による印字を視覚することができるものである。

又、第2凶々示例の様々長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配録紙の様方向の長さとほど等長のインク吐出孔列を偏えた長尺へ、ドを用いる場合には、走査回数が1回で済むので、第1個々示例のへ、ドを用いる場合に枚べて印字所要時間をかなり短縮するととができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c)に於て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生素子2,12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発明によれば、

- 1. 特に印字の成方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生素子 に抵近接して高密度に配列されている為、書 型にしてコンパクトに構成できる。

# 持開昭58-116165(4)



